

Від редакції От редакции From the publishers	4
<i>Достанко А.П., Бордусов С.В.</i> Плазменные СВЧ технологии в процессах инженерии поверхности.....	7
<i>Хороших В.М.</i> Стационарная вакуумная дуга в технологических системах для обработки поверхностей.....	19
<i>Валиев К.А., Маишев Ю.П., Шевчук С.Л.</i> Реактивный ионно-лучевой синтез тонких пленок непосредственно из пучков ионов	27
<i>Lisovskiy V., Booth J.-P.</i> Simulation of the ignition of a low pressure RF capacitive discharge	34
<i>Береснев В.М., Гриценко В.И., Швец О.М.</i> Использование ВЧ разряда в методе вакуумно-дугового осаждения покрытий	37
<i>Белоус В.А., Лапшин В.И., Марченко И.Г., Неклюдов И.М.</i> Радиационные технологии модификации поверхности. I. Ионная очистка и высокодозовая имплантация	40
<i>Пашнев В.К., Стрельницкий В.Е., Опалев О.А., Грицина В.И., Выровец И.И., Бизюков Ю.А., Брык В.В., Колупаева З.И.</i> Осаждение алмазных покрытий с использованием тлеющего разряда, стабилизированного магнитным полем	49
<i>Guglya A., Virich V., Styervoyedov A., Silkin M.</i> Distribution of interstitial impurities in chromium coating, obtained by ion beam assisted deposition	56
<i>Милославский В.К., Агеев Л.А.</i> Светоиндуцированные спонтанные решетки в волноводных пленках.....	59
<i>Богатыренко С.И., Гладких Н.Т., Крышталь А.П.</i> Понижение температуры плавления с уменьшением толщины пленок Bi, In, Pb и Sn в Al матрице	82
<i>Дукаров С.В., Гладких Н.Т., Бородин С.А.</i> Температурная зависимость смачивания в переохлажденных конденсатах олова на углеродной подложке	89
<i>Осинский В.И., Гончаренко Т.И., Ляхова Н.Н.</i> Влияние обработки поверхности чипов на экстракцию излучения сверхярких светодиодов на гетероструктурах InGa /Al ₂ O ₃	94
<i>Азаренков Н.А., Зыкова А.В., Клепиков В.Ф., Лапшин В.И., Фареник В.И.</i> Учебно-научные комплексы в области высоких технологий	99